

Title (en)

Ion diode incorporating a magnetic mirror.

Title (de)

Ionenquelle mit magnetischem Spiegel.

Title (fr)

Diode à ions à miroir magnétique.

Publication

EP 0214031 A1 19870311 (FR)

Application

EP 86401784 A 19860808

Priority

FR 8512278 A 19850812

Abstract (en)

The diode comprises an anode (20), a cathode (22) and a winding (24) creating a divergent magnetic field behind the anode. Electrons which cross the anode are repelled towards it. Application as ion source. <IMAGE>

Abstract (fr)

Diode à ions à miroir magnétique. La diode comprend une anode (20), une cathode (22) et un enroulement (24) créant, derrière l'anode, un champ magnétique divergent. Les électrons qui franchissent l'anode sont repoussés vers celle-ci. Application comme source d'ions.

IPC 1-7

H01J 27/02; H01J 27/14

IPC 8 full level

H01J 27/02 (2006.01)

CPC (source: EP)

H01J 27/02 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] US 4126806 A 19781121 - KAPETANAKOS CHRISTOS A, et al
- [A] US 2806161 A 19570910 - FOSTER JR JOHN S
- [A] US 2785311 A 19570312 - LAWRENCE ERNEST O
- [A] GB 931076 A 19630710 - ATOMIC ENERGY COMMISSION
- [AD] NUCLEAR FUSION, vol. 20, no. 12, 1980, pages 1549-1612, Vienne, AT; S. HUMPHRIES, Jr.: "Intense pulsed ion beams for fusion applications"

Cited by

US7492621B2

Designated contracting state (EPC)

DE GB NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0214031 A1 19870311; FR 2586139 A1 19870213; FR 2586139 B1 19871030

DOCDB simple family (application)

EP 86401784 A 19860808; FR 8512278 A 19850812